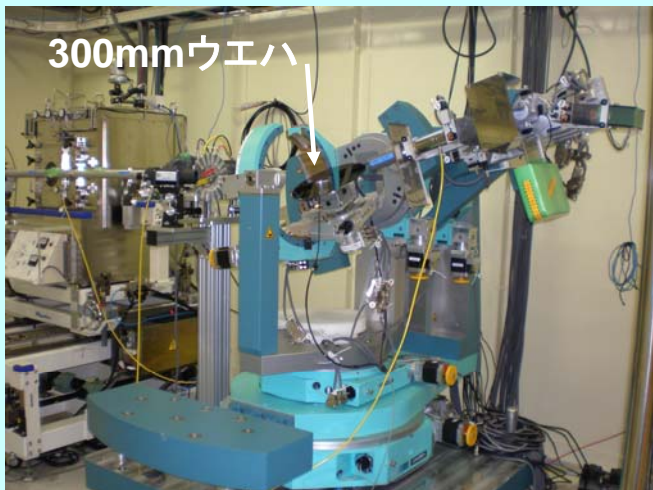


【回折SG】
 (株)富士通研究所 淡路、野村、土井 三菱電機(株) 河瀬
 (株)神戸製鋼所 稲葉、北原 パナソニック(株) 尾崎
 日亜化学工業(株) 川村、榊 (株)豊田中央研究所 山口
 川崎重工業(株) 井頭、尾角、柳瀬 関西電力(株) 出口
 住友電気工業(株) 飯原、斉藤、上村 (株)日立製作所 平野
 スプリングエイトサービス(株) 梅本、高尾

HUBER8軸回折計



300mmウエハ

装置組み立て



各種試料台



調整治具



計測・制御コントローラ



試料位置
確認用
スコープ

YAP
検出器
(BEDE)



要旨

サンビーム装置の中で、最も利用の多い、
回折・散乱実験において、

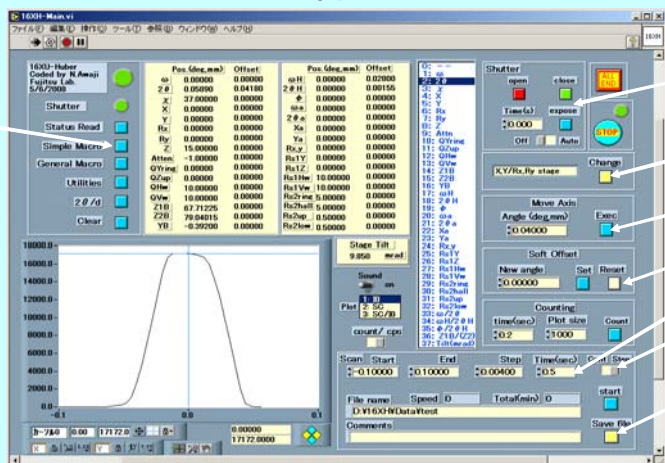
●高精度・高自由度の実験可能
独HUBERの大型・高精度8軸回折計導入

●測定時間の短縮(~1/2)
計測・制御一体型コントローラ採用
高計数のYAP検出器(BEDE)導入

●各種試料・各種測定に対応
各種ウエハ試料台・測定位置確認スコープ
面内測定、ウエハマッピング、広角度測定

➡300mmウエハ測定、反射率12桁測定、
微小領域(10μm)測定可能

制御画面



シャッタ
操作

試料台
交換

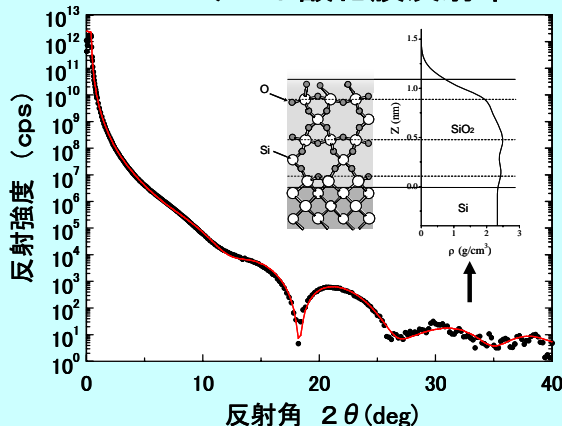
軸移動

オフセット
設定

スキャン
連続・
ステップ
選択

データ
保存

1nmゲート酸化膜反射率



粉末試料

